

高压硅半导体器件耐压与表面绝缘技术



作者：徐传骧主编

出版社：北京：机械工业出版社

出版日期：1981.11

总页数：206

说明：登录教客网（<https://www.jiaoke.com/book/detail/10533416.html>）查找全本阅读方式

高压硅半导体器件耐压与表面绝缘技术 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/10533416.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/10533416.html>

书名：高压硅半导体器件耐压与表面绝缘技术